Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/005979

International filing date: 29 March 2005 (29.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-351088

Filing date: 03 December 2004 (03.12.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 16 June 2005 (16.06.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

Date of Application: 2004年12月 3日

出 願 番 号

Application Number: 特願 2 0 0 4 - 3 5 1 0 8 8

バリ条約による外国への出願 に用いる優先権の主張の基礎 となる出願の国コードと出願 番号

The country code and number of your priority application, to be used for filing abroad under the Paris Convention, is JP2004-351088

出 願 人

三井化学株式会社

Applicant(s):

2005年

6月 1日





特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 【書類名】 特許願 【整理番号】 P 0 0 0 3 7 3 5 【提出日】 平成16年12月 3日 【あて先】 特許庁長官 殿 【国際特許分類】 H01L 51/40【発明者】 【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化学株式会社内 【氏名】 藤山 高広 【発明者】 【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化学株式会社内 【氏名】 杉本 賢一 【特許出願人】 【識別番号】 000005887 【氏名又は名称】 三井化学株式会社 【代表者】 中西 宏幸 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 005278 【納付金額】 16,000円 【提出物件の目録】 【物件名】 特許請求の範囲

 【物件名】
 明細書 1

 【物件名】
 図面 1

 【物件名】
 要約書 1

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

有機半導体層を有する有機トランジスタにおいて、該有機半導体層が下記一般式(1)で表されるテトラカルボン酸誘導体を含むことを特徴とする有機トランジスタ。

【化1】

$$X-N$$
 Z_1
 N
 Z_2
 $N-Y$

... (1)

[式中、X、Yは、それぞれ独立に水素原子、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアルキル基、置換または未置換のシクロアルキル基、置換または未置換のアラルキル基からなる群より選ばれる基を表す。また、式中、 Z_1 、 Z_2 は、それぞれ独立にテトラカルボン酸及びその誘導体を構成する 4 価の有機基を表す。]

【書類名】明細書

【発明の名称】テトラカルボン酸誘導体を用いた有機薄膜トランジスタ

【技術分野】

$[0\ 0\ 0\ 1\]$

本発明は、テトラカルボン酸誘導体を半導体層に用いた有機トランジスタ、TFT(Thin Film Transistor)に関する。更に詳しくは、高い駆動速度や高いオン/オフ比を有する有機TFTに関する。

【背景技術】

[00002]

薄膜トランジスタは、液晶表示装置等の表示用のスイッチング素子として広く用いられている。従来、薄膜トランジスタ(TFT)は、アモルファスや多結晶のシリコンを用いて作製されていた。しかし、このようなシリコンを用いたTFTの作製に用いられるCVD装置は、非常に高額であり、TFTを用いた表示装置等の大型化は、製造コストの大幅な増加を伴うという問題点があった。また、アモルファスや多結晶のシリコンを成膜するプロセスは非常に高い温度下で行われるので、基板として使用可能な材料の種類が限られ、従って、軽量な樹脂基板等は使用できないという問題があった。

[00003]

上記問題を解決するために、アモルファスや多結晶のシリコンに代えて有機半導体を用いたTFTが提案されている。有機半導体を用いた薄膜トランジスタの開発は、1980年代後半から徐々に活発になってきており、近年では基本性能としてアモルファスシリコンの薄膜トランジスタの特性を越えるに至っている。有機半導体でTFTを形成する際に用いる成膜方法として真空蒸着法や塗布法等が知られているが、これらの成膜方法によれば、コストアップを抑えつつ素子の大型化が実現可能になり、成膜時に必要となるプロセス温度を比較的低温にすることができる。このため、有機半導体を用いたTFT(以下、「有機TFT」と呼ぶ)では、基板に用いる材料の選択時の制限が少ないといった利点が得られ、その実用化が期待される。さらには、スマートカード、セキュリティタグとして潜在的な可能性を有していることでも注目されている。

$[0\ 0\ 0\ 4]$

有機TFTの性能は、主として有機化合物の電荷移動度および電流オン/オフ比に基づいており、従って理想的には電流オフ状態では低伝導性を、高い電荷移動性とともに有している必要がある。ここで「オン/オフ比」という用語は、有機TFTがオンであるときのソース-ドレイン電流の、有機TFTがオフであるときのソースードレイン電流に対する比を意味する。

$[0\ 0\ 0\ 5\]$

有機TFTの有機化合物層に用いる有機物としては、共役系ポリマーやチオフェンなどの多量体、或いは、金属フタロシアニン化合物、またはペンタセンなどの縮合芳香族農化水素などが、単体或いは他の化合物との混合で用いられる。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0006]

しかし、上述のように有機TFTに関する研究が盛んに行われているが、従来の有機TFTはそのいずれもが、用いられる化合物の性能が不十分であり、動作速度が遅く、実用上十分なオン/オフ比を有することができなかった。

[0007]

本発明は、上記に鑑み、高速で動作し、高いオン/オフ比を有する有機薄膜トランジスタを提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0008]

本発明者らは前記課題を解決するために鋭意検討した結果、一般式(1)で示されるテトラカルボン酸誘導体が、有機TFTの動作速度及びオン/オフ比が大きく向上すること

を見出し、本発明を完成するに至った。

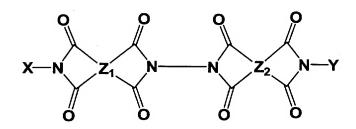
[0009]

すなわち、本発明は、

1. 有機半導体層を有する有機トランジスタにおいて、該有機半導体層が下記一般式(1)で表されるテトラカルボン酸誘導体を含むことを特徴とする有機トランジスタ。

 $[0\ 0\ 1\ 0\]$

【化1】



... (1)

 $[0\ 0\ 1\ 1]$

[式中、X、Yは、それぞれ独立に水素原子、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアルキル基、置換または未置換のシクロアルキル基、置換または未置換のアラルキル基からなる群より選ばれる基を表す。また、式中、 Z_1 、 Z_2 は、それぞれ独立にテトラカルボン酸及びその誘導体を構成する 4 価の有機基を表す。]に関する。

【発明の効果】

 $[0\ 0\ 1\ 2]$

本発明により得られるテトラカルボン酸誘導体は電荷移動性に優れ、該化合物を有機TFTに用いた場合には、動作速度及びオン/オフ比が大きく向上しつつ、かつ電気特性、繰り返し安定性にも優れた高耐久性の有機TFTが得られる。

【発明を実施するための最良の形態】

 $[0\ 0\ 1\ 3\]$

以下、本発明を詳細に説明する。

本発明の有機トランジスタで用いられるテトラカルボン酸誘導体とは、一般式(1)で表される化合物である。

 $[0\ 0\ 1\ 4]$

【化2】

$$X-N$$
 Z_1
 N
 Z_2
 $N-Y$

... (1)

 $[0\ 0\ 1\ 5]$

[式中、X、Yは、それぞれ独立に水素原子、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアルキル基、置換または未置換のシクロアルキル基、置換または未置換のアラルキル基からなる群より選ばれる基を表す。また、式中、 Z_1 、 Z_2 は、それぞれ独立にテトラカルボン酸及びその誘導体を構成する 4 価の有機基を表す。]

 $[0\ 0\ 1\ 6\]$

まず、一般式(1)で表される化合物におけるX、Yについて説明する。XとYは、同じであっても異なっていてもよく、水素原子、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアルキル基、置換または未置換のアラ

ルキル基からなる群より選ばれる基である。

$[0\ 0\ 1\ 7\]$

アリール基としては、特に制限はないが、中でも炭素数 6~30の置換または未置換の 炭素環式芳香族基、炭素数 3~25の置換または未置換の複素環式芳香族基が好ましく、 炭素数 6~25の置換または未置換の炭素環式芳香族基、炭素数 4~12の置換または未 置換の複素環式芳香族基がより好ましく、炭素数 6~22の置換または未置換の炭素環式 芳香族基、炭素数 4~10の置換または未置換の複素環式芳香族基がさらに好ましい。具 体的には、フェニル基、ナフチル基、アントリル基、ビフェニル基、チエニル基、ビチエ ニル基、フリル基、ピリジル基などが挙げられる。

[0018]

アルキル基としては、特に制限はないが、中でも炭素数1~25、好ましくは炭素数1~10の炭素原子を有する直鎖、分岐または環状のアルキル基が好ましい。具体的には、メチル基、エチル基、ロープロピル基、ローブチル基、ローペンチル基、ローヘキシル基、ローペプチル基、ローオクチル基、デシル基といった直鎖状のもの、iープロピル基、sーブチル基、tーブチル基、メチルプロピル基、ジメチルプロピル基、エチルプロピル基、ジエチルプロピル基、メチルブチル基、ジメチルブチル基、メチルペンチル基、ジメチルブチル基、メチルペンチル基、ジメチルペンチル基、ジメチルペンチル基、ジメチルペンチル基、ジメチルペンチル基、メチルペンチル基、ジメチルペキシル基などの分岐状のものなどが挙げられる。

$[0\ 0\ 1\ 9]$

シクロアルキル基としては、特に制限はないが、中でも炭素数1~25、好ましくは炭素数1~10の炭素原子を有するシクロアルキル基が好ましい。具体的には、シクロプロバンからシクロデカンまでの同属環、メチルシクロペンタン、ジメチルシクロペキサン、テトラメチルシクロヘキサン、ジメチルシクロヘキサン、テトラメチルシクロヘキサン、エチルシクロヘキサン、ジエチルシクロヘキサンなどのアルキル置換基を有するものなどが挙げられる。

[0020]

アラルキル基としては、特に制限はないが、中でも炭素数 6~14のアラルキル基が好ましい。具体的には、ベンジル基、1-フェニルエチル基、3-フェニルプロピル基、4-フェニルブチル基、5-フェニルペンチル基、6-フェニルへキシル基、ベンズヒドリル基、トリチル基、フェネチル基などが挙げられる。

$[0\ 0\ 2\ 1]$

また、X、Yに相当するアリール基、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基は置換基を有していても良く、具体的にはヒドロキシアルキル基、アルコキシアルキル基、モノアルキルアミノアルキル基、ジアルキルアミノアルキル基、ハロゲン置換アルキル基、アルコキシカルボニルアルキル基、カルボキシアルキル基、アルカノイルオキシアルキル基、アミノアルキル基、ハロゲン原子、アミノ基、ヒドロキシ基、エステル化されていてもよいカルボキシル基、シアノ基などの他、炭素数1~4の置換基を有してもよいアルキル基や炭素数1~6の置換基を有してもよいアルコキシ基などが挙げられる。なお、これらの置換基の置換位置については特に限定されない。

[0022]

次に、一般式(1)で表される化合物における Z_1 、 Z_2 について説明する。 Z_1 、 Z_2 は、それぞれ独立にテトラカルボン酸及びその誘導体を構成する4価の有機基である。4価の有機基としては、脂環族基、脂肪族基、芳香族基、あるいは複数の芳香族基が直接結合、カルボニル基、スルホン基、スルホキシド基、エーテル基またはスルフィド基などの架橋員により相互に連結された芳香族基を挙げることができる。

[0023]

脂環族基としては、特に制限はないが、中でも炭素数4~25、好ましくは炭素数4~10の炭素原子を有する脂環族基が好ましい。具体的には、例えば、テトラカルボン酸及びその誘導体を構成する4価の有機基において、テトラカルボン酸及びその誘導体がテトラカルボン酸二無水物であり、4価の有機基が脂環族基である場合、即ち、脂環族基を有

[0024]

脂肪族基としては、特に制限はないが、中でも炭素数 4~25、好ましくは炭素数 4~10の炭素原子を有する脂肪族基が好ましい。具体的には、例えば、テトラカルボン酸及びその誘導体を構成する 4 価の有機基において、テトラカルボン酸及びその誘導体がテトラカルボン酸二無水物であり、 4 価の有機基が脂肪族基である場合、即ち、脂肪族基を有するテトラカルボン酸二無水物の具体例として、ブタンテトラカルボン酸二無水物、ペンタンテトラカルボン酸二無水物などが挙げられる。

[0025]

芳香族基としては、特に制限はないが、中でも炭素数 6 ~ 3 0 の置換または未置換の炭素環式芳香族基、炭素数 3 ~ 2 5 の置換または未置換の複素環式芳香族基が好ましく、炭素数 6 ~ 2 5 の置換または未置換の炭素環式芳香族基、炭素数 4 ~ 1 2 の置換または未置換の複素環式芳香族基がより好ましく、炭素数 6 ~ 2 2 の置換または未置換の炭素環式芳香族基、炭素数 4 ~ 1 0 の置換または未置換の複素環式芳香族基がさらに好ましい。

[0026]

具体的には、例えば、テトラカルボン酸及びその誘導体を構成する4価の有機基におい て、テトラカルボン酸及びその誘導体がテトラカルボン酸二無水物であり、4価の有機基 が芳香族基である場合、即ち、芳香族基を有するテトラカルボン酸二無水物の具体例とし て、ピロメリット酸二無水物、3,3,,4,4,一ベンゾフェノンテトラカルボン酸二 無水物、3,3~,4,4~-ビフェニルスルホンテトラカルボン酸二無水物、1,2, 5,6-ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、1,4,5,8-ナフタレンテトラカル ボン酸二無水物、2,3,6,7ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、2,3,6, 7-アントラセンテトラカルボン酸二無水物、1,2,5,6-アントラセンテトラカル ボン酸二無水物、3,4,9,10-ペリレンテトラカルボン酸二無水物、3,3,,4 , 4 'ービフェニルエーテルテトラカルボン酸二無水物、3, 3', 4, 4'ージメチル ジフェニルシランテトラカルボン酸二無水物、3,3~,4,4~一テトラフェニルシラ ンテトラカルボン酸二無水物、1,2,3,4-フランテトラカルボン酸二無水物、4, 4 ' ービス(3,4 ージカルボキシフェノキシ)ジフェニルスルフィド二無水物、4 , 4 ' ービス(3,4ージカルボキシフェノキシ)ジフェニルスルホン二無水物、4,4'ー ビス(3,4ージカルボキシフェノキシ)ジフェニルプロパン二無水物、3,3, 4 ^ ーパーフルオロイソプロピリデンジフタル酸二無水物、3,3 ^ , 4 , 4 ' ービフェ ニルテトラカルボン酸二無水物、2,3,3,4-ビフェニルテトラカルボン酸二無 水物、2,3,4,5-ピリジンテトラカルボン酸二無水物、2,6-ビス(3,4-ジ カルボキシフェニル)ピリジン二無水物、ビス(フタル酸)フェニルホスフィンオキサイ ド二無水物、p-フェニレンービス(トリフェニルフタル酸)二無水物、m-フェニレン ービス(トリフェニルフタル酸)二無水物、ビス(トリフェニルフタル酸)-4,4^-ジフェニルエーテル二無水物、ビス(トリフェニルフタル酸)-4,4'-ジフェニルメ タン二無水物などが挙げられる。

[0027]

また、 Z_1 、 Z_2 に相当するテトラカルボン酸及びその誘導体を構成する4価の有機基はさらに置換基を有していても良く、具体的にはヒドロキシアルキル基、アルコキシアルキル基、モノアルキルアミノアルキル基、ジアルキルアミノアルキル基、ハロゲン置換アルキル基、アルコキシカルボニルアルキル基、カルボキシアルキル基、アルカノイルオキシアルキル基、アミノアルキル基、ハロゲン原子、アミノ基、ヒドロキシ基、エステル化されていてもよいカルボキシル基、シアノ基などの他、炭素数 $1\sim4$ の置換基を有してもよいアルキル基や炭素数 $1\sim6$ の置換基を有してもよいアルコキシ基などが挙げられる。なお、これらの置換基の置換位置については特に限定されない。

[0028]

以下に、前記一般式(1)で示される化合物の具体例を挙げるが、これらの化合物に限 定されるものではない。

[0029]

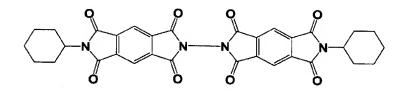
(1)

(2)

(3)

(4)

[0030]



(5)

(6)

. (7)

(8)

[0031]

$$(H_3C)_3C$$
 $(C(CH_3)_3$ $(C(CH_3)_3$ $(C(CH_3)_3$ $(C(CH_3)_3$ $(C(CH_3)_3$

[0032]

(13)

$$CH_3 O O O F F$$

$$C_2H_5 O O F F$$

$$(15)$$

[0033]

(17)

(18)

(19)

[0034]

(21)

$$CH_3$$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

$$H_3C$$
 N
 N
 CH_3
 CH_3
 CH_3

[0035]

(25)

(26)

(27)

(28)

[0036]

(29)

(31)

(32)

[0037]

[0038]

(38)

$$(40)$$

[0039]

$$H_3C$$
 N
 N
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

[0040]

【表 1 2】

(45)

[0041]

(51)

[0042]

(55)

$$C_2H_5$$
 O C_3H_5 O C_2H_5 O C_2H_5 O C_3H_5 O

(56)

[0043]

(57)

$$F_3C(F_2C)_2H_2C-N$$

$$(59)$$

(60)

[0044]

[0045]

(65)

(68)

[0046]

(69)

(71)

(72)

[0047]

(76)

[0048]

本発明の有機薄膜トランジスターに用いられるテトラカルボン酸誘導体の合成法は特に限定されるものではないが、公知の合成方法(例えば、特開 2001-265031 号公報や J . Am . Chem . Soc. , 120 , 3231(1998) . や J . Tet rahedron Letters, 42 , 3559(2001) . や特開昭 49-

69674号公報など)により、例えば下記反応式(スキーム1と2)のごとく合成される。すなわち、アリール骨格としてナフタレンを選択した場合、ナフタレンカルボン酸もしくはその無水物をアミン類と反応させ、モノイミド化する方法、ナフタレンカルボン酸もしくはその無水物を緩衝液によりpH調整して、アミン類と反応させる方法などにより得られる。

【0049】

スキーム1

【0050】

スキーム2

$[0\ 0\ 5\ 1]$

モノイミド化は、無溶媒もしくは溶媒存在下で行なう。溶媒としては、ベンゼン、トルエン、キシレン、クロロナフタレン、酢酸、ピリジン、ピコリン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ジメチルエチレンウレア、ジメチルスルホキサイドなど、原料や生成物と反応せず、50万至250℃の温度で反応させられるものを用いる。

$[0\ 0\ 5\ 2]$

pH調整には、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどの塩基性水溶液とリン酸などの酸との混合により作成した緩衝液を用いる。

[0053]

モノイミド化したテトラカルボン酸誘導体をNーアミノ化する合成法は特に限定されるものではないが、公知の合成方法(例えば、J.Am.Chem.Soc., 118,81(1996).など)により合成することができる。Nーアミノ化は、無溶媒もしくは溶媒存在下で行なう。溶媒としては、ベンゼン、トルエン、キシレン、クロロナフタレン、酢酸、ピリジン、ピコリン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ジメチルエチレンウレア、ジメチルスルホキサイドなど、原料や生成物と反応せず、50乃至250℃の温度で反応させられるものを用いる。

[0054]

モノイミド化カルボン酸誘導体とN-アミノ化カルボン酸誘導体の脱水反応は、無溶媒もしくは溶媒存在下で行なう。溶媒としては、ベンゼン、トルエン、キシレン、クロロナフタレン、ブロモナフタレン、無水酢酸など、原料や生成物と反応せず、50乃至250 ℃の温度で反応させられるものを用いる。

[0055]

いずれの反応も、無触媒もしくは触媒存在下で行なってよく、特に限定されないが、例えばモレキュラーシーブスやベンゼンスルホン酸やpートルエンスルホン酸などを脱水剤として用いることができる。

[0056]

本発明の有機薄膜トランジスターの実施形態について、図面を参照しながら説明する。図1は本発明の有機TFTの一実施例を示す概念図である。この有機TFTは、基板11上にゲート電極21を作成し、そのゲート電極上に絶縁体層31を積層し、その上に所定の間隔をあけて形成されたソース電極61およびドレイン電極41を並列にかつ同時に作成し、その上から有機薄膜層51が形成されている(ボトムコンタクト構造)。もしくは、図2に示すように、基板12上にゲート電極22を作成し、そのゲート電極上に絶縁体層32を積層し、その上にさらに有機薄膜層52を積層し、その上からソース電極62およびドレイン電極42を並列かつ同時に作成されている(トップコンタクト構造)。

$[0\ 0\ 5\ 7]$

このような構成を有する有機TFTでは、有機薄膜層がチャネル領域を成しており、ゲート電極に印加される電圧でソース電極とドレイン電極の間に流れる電流が制御されることによってオン/オフ動作する。

[0058]

一般式(1)で表される化合物を含有する有機薄膜層はドーピング処理を施しても良い。ここでドーピングとは、電子受容性分子(アクセプター)または電子供与性分子(ドナー)をドーバントとして該薄膜に導入することを意味する。従って、ドーピングが施された薄膜は、一般式(1)で表される化合物とドーパントを含有する薄膜である。本発明に用いるドーバントとしてアクセプター、ドナーのいずれも使用可能である。

[0059]

本発明におけるドナー性ドーパントとしては、有機薄膜層の有機化合物分子に電子を供与する役割を果たすものならはどのようなものでも用いることが出来る。特に好適な例としては、Li、Na、K、Rb、Cs などのアルカリ金属、Ca、Sr、Ba などのアルカリ土類金属、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Yb などの希土類金属、アンモニウムイオン、 R_4P^+ 、 R_4As^+ 、 R_3S^+ 、アセチルコリンなどが挙げられる。

[0060]

本発明におけるアクセプター性ドーパントとしては、有機薄膜層の有機化合物分子から電子を取り去る役割を果たすものならはどのようなものでも用いることが出来る。特に好適な例として、С 1_2 、 B r 2、 I 2、 I C 1、 I C 1_3 、 I B r、 I F などのハロゲン、P F $_5$ 、 A s F $_5$ 、 S b F $_5$ 、 B F $_3$ 、 B C 1_3 、 B B r $_3$ 、 S O $_3$ などのルイス酸、H F、H C 1、 H N O $_3$ 、 H $_2$ S O $_4$ 、 H C 1 O $_4$ 、 F S O $_3$ H、 C 1 S O $_3$ H、 C F $_3$ S O $_3$ H などのプロトン酸、酢酸、蟻酸、アミノ酸などの有機酸、F e C 1_3 、F e O C

[0061]

これらのドーバントのドーピングの方法としては、予め有機半導体の薄膜を作製しておき、ドーバントを後で導入する方法、有機半導体の薄膜作製時にドーバントを導入する方法、有機半導体の薄膜作製時にドーバントを導入が大力を活力に対して、ガス状態のドーバントを該立して、ガス状態のドーバントを該薄膜に接触させてドービングする流域をのドーバントを該薄膜に接触させてドービングする面相ドーピング、個体状態のドーバントを該薄膜に接触させてドービングに指するできる。また液相ドーピングにおいては電解を施すことによってドーピングの効率を調整することができる。できるがでは、有機半導体化合物とドーバントの混合溶液あるいは分散液を同いる場合、有機半導体とともにドーバントの共活として真空蒸着法を用いる場合、有機半導体とともにドーバントを共蒸着することによりドーバントを導入することができる。また(後述する有機薄膜の形成方法として)スパッタリング法で薄膜を作製する場合、有機半導体化合物とドーバントを共立とによりドーバットを導入することができる。また(後述する有機薄膜の形成方法として)スパッタリングはで薄膜中にドーバントを増入させることができる。さらに他の方法として、電気化学的ドーピングの何れも使用可能である。

[0062]

有機薄膜の形成方法としては、特に限定されることはなく、従来公知の一般的な薄膜形成方法を用いることが可能である。具体的には、真空蒸着法、分子線エピタキシャル成長法、イオンクラスタービーム法、低エネルギーイオンビーム法、イオンプレーティング法、CVD法、スパッタリング法、プラズマ重合法、電解重合法、化学重合法、スプレーコート法、スピンコート法、ブレードコート法、デイップコート法、キャスト法、ロールコート法、バーコート法、ダイコート法およびLB法等が挙げられ、材料に応じて使用できる。本有機TFTに用いる、前記一般式(1)で表される化合物を含有する有機薄膜層は、溶媒に溶かした溶液のディップコート法、スピンコーテート法、キャスティング法、バーコート法、ロールコート法等の塗布法が好まれる。

[0063]

$[0\ 0\ 6\ 4]$

また、本発明における基板としては、特に限定されず、いかなる物を用いても良い。一般に好適に用いられる物は、石英などのガラスやシリコンウェハーの他、プラスチック基板なども用いることが可能である。プラスチック基板としては、例えばポリエチレンテレフタレート(PEN)、ポリエーテルスルホン(PES)、ポリエーテルイミド、ポリエーテルエーテルケトン、ポリフェニレンスルフィド、ポリアリレート、ポリイミド、ボリカーボネート(PC)、セルローストリアセテート(TAC)、セルロースアセテートプロピオネート(CAP)等からなる基板等が挙げられる。

$[0\ 0\ 6\ 5]$

本発明においてソース電極、ドレイン電極及びゲート電極に夫々用いることが可能な材料としては、導電性材料であれば特に限定されず、酸化インジウム錫合金(ITO)、酸化錫(NESA)、金、銀、白金、銅、インジウム、アルミニウム、マグネシウム、ニッ

ケル、クロム、鉄、錫、タンタル、バラジウム、テルル、イリジウム、ルテニウム、ゲルマニウム、タングステン、リチウム、ベリリウム、ナトリウム、カリウム、カルシウム、亜鉛、マグネシウム/インジウム合金、マグネシウム/銅合金、アルミニウム/スカンジウム/リチウム合金、ナトリウム/カリウム合金等の金属や合金の他、フッ素ドープ酸化亜鉛、炭素、グラファイト、グラッシーカーボン、銀ペーストおよびカーボンペトなどが用いられる。特に、白金、金、銀、銅、アルミニウム、インジウム、ITOおよび炭素が好ましい。また、ドービング等で導電率を向上させた公知の導電性ポリマー、例えば、導電性ポリアニリン、導電性ポリピロール、導電性ポリチオフェン、ポリエチレンジオキシチオフェン(PEDOT)とポリスチレンスルホン酸(PSS)の錯体なども好適に用いられる。ソース電極、ドレイン電極は、上に挙げた中でも有機薄膜層との接触面において電気抵抗が少ないものが好ましい。

[0066]

本発明における電極の形成方法としては、上記を原料として蒸着やスパッタリング等の方法を用いて形成した導電性薄膜を、公知のフォトリソグラフ法やリフトオフ法を用いて電極形成する方法、アルミニウムや銅などの金属箔上に熱転写、インクジェット等によるレジストを用いてエッチングする方法がある。また導電性ポリマーの溶液あるいは分散液、導電性微粒子分散液を直接インクジェットによりパターニングしてもよいし、塗工膜からリソグラフやレーザーアブレーションなどにより形成してもよい。さらに導電性ポリマーや導電性微粒子を含むインク、導電性ペーストなどを凸版、凹版、平版、スクリーン印刷などの印刷法でパターニングする方法も用いることができる。

[0067]

本発明においてゲート絶縁層である絶縁体層に用いる材料としては種々の絶縁物を用いることができるが、特に、比誘電率の高い無機酸化物皮膜あるいは有機化合物皮膜が好ましい。無機酸化物としては、酸化ケイ素、窒化ケイ素、酸化アルミニウム、酸化タンタル、酸化チタン、酸化スズ、酸化バナジウム、チタン酸バリウムストロンチウム、ジルコニウム酸チタン酸鉛、チタン酸鉛ランタン、チタン酸ストロンチウム、チタン酸バリウム、フッ化バリウムマグネシウム、チタン酸ビスマス、チタン酸ストロンチウムビスマス、タンタル酸ストロンチウムビスマス、タンタル酸ストロンチウムビスマス、タンタル酸ニオブ酸ビスマス、ペントオキサイドタンタル、ジオキサイドチタン、トリオキサイドイットリウムなどが挙げられる。それらのうち好ましいのは、酸化ケイ素、窒化ケイ素、酸化アルミニウム、酸化タンタル、酸化チタンである。

[0068]

無機酸化物皮膜の形成方法としては、真空蒸着法、分子線エピタキシャル成長法、イオンクラスタービーム法、低エネルギーイオンビーム法、イオンプレーティング法、CVD法、スパッタリング法、大気圧プラズマ法などのドライプロセスや、スプレーコート法、スピンコート法、ブレードコート法、ディップコート法、キャスト法、ロールコート法、バーコート法、ダイコート法などの塗布による方法、印刷やインクジェットなどのパターニングによる方法などのウェットプロセスが挙げられ、材料に応じて使用できる。

[0069]

ゲート絶縁層に用いる有機化合物皮膜としては、ポリイミド、ポリアミド、ポリエステル、ポリアクリレート、光ラジカル重合系、光カチオン重合系の光硬化性樹脂、あるいはアクリロニトリル成分を含有する共重合体、ポリビニルフェノール、ポリビニルアルコール、ノボラック樹脂、ポリフッ化ビニリデン(PVF)およびシアノエチルプルラン等を用いることもできる。有機化合物皮膜の形成法としては、前記ウェットプロセスが好ましい。

[0070]

以下、実施例により具体的に説明するが、本発明は何らこれらに限定されない。

$[0\ 0\ 7\ 1]$

[合成例1] (具体的例示化合物(14))

【0072】 【化5】

$$H_3C(H_2C)_{11}$$
 $H_3C(H_2C)_{11}$ $H_3C(H_2C)$

[0073]

第一工程 ナフタレンモノイミド体(1-1)の合成

ナフタレンー1,4,5,8ーテトラカルボン酸二無水物27.68g、脱水DMF250m1を装入した反応器を、加熱還流させた。これに、脱水DMF110m1に溶解させたドデシルアミン21.03gを、撹拌しながら50分で滴下した。滴下終了後、更に6時間加熱還流させた。冷却後、減圧濃縮し、残渣をトルエンで希釈して、不溶分を濾去した。シリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し、目的の淡黄色のナフタレンモノイミド体(1-1)を得た。収量:16.6g。

 $[0\ 0\ 7\ 4]$

第二工程 ナフタレンモノイミドNH2直結体(1-2)の合成

ナフタレンー1,4,5,8ーテトラカルボン酸二無水物42.0g、脱水DMF400m1を装入した反応器を、加熱還流させた。これに、脱水DMF100m1に溶解させた2ーヘプチルアミン 18.9gを、撹拌しながら50分で滴下した。滴下終了後、更に6時間加熱還流させた。冷却後、減圧濃縮し、残渣をトルエンで希釈して、不溶分を濾去した。シリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し、淡黄色のモノイミド体を得た。収量:25.3g

このようにして得られたナフタレンモノイミド体 10.0g、脱水 DMF100m1 を装入し溶解させた。次に、ヒドラジン・一水和物 1.52g を 2 分で滴下し、室温で 1.5 時間反応させた。メタノールを滴下し析出した結晶を濾過、メタノール洗浄、乾燥してナフタレンモノモノイミド NH_2 直結体 (1-2) を得た。収量: 9.1g。

[0075]

第三工程

[0076]

融点を測定したところ、274.1 Cであった。FD-MSにより質量分析した結果、M/z=796 であることから、目的物であると同定した。

【実施例1】

[0077]

<有機TFT素子作製及び評価>

まず、ガラス基板上にCrMo膜をスパッタリング法により100nmの膜厚で成膜してゲート電極とした。次いで、このゲート電極上に、酸化シリコン(SiO2)膜をスパ

ッタリング法により300nmの膜厚に成膜し、これを絶縁体層とした。

[0078]

引き続き、真空蒸着法により、具体的例示化合物(14)を300nmの膜厚で形成し、有機薄膜層とした。更に、この有機薄膜層の上に、真空蒸着法により、金属マスクを通して、金を100nmの膜厚でストライプ状に成膜して、ソース電極及びドレイン電極を形成し、有機TFTを得た。

[0079]

作製した有機TFTのゲート電極に周波数1kHz、最大電圧20Vの矩形波電圧を、ソースードレイン間に20Vの直流電圧を夫々印加した。この状態で、ソースードレイン電極間の電流のオン時の応答立ち上がり時間(全変化量の10%変化時変化時から90%の変化時までの時間)を測定したところ、 1μ s未満であった。

[080]

また、作製した有機 T F T に 50 V のゲート電圧を印加したところ、ソースードレイン電極間の電流のオン/オフ比は 4×10^5 であった。

【産業上の利用可能性】

[0081]

本発明により得られるテトラカルボン酸誘導体は電子輸送性に優れ、該化合物を有機TFTに用いた場合には、高い駆動速度や高いオン/オフ比を有する有機TFTが得られる

【図面の簡単な説明】

[0082]

【図1】本発明に係る有機薄膜トランジスタの一例の模式的断面図である。

【図2】本発明に係る有機薄膜トランジスタの別の一例の模式的断面図である。

【符号の説明】

[0083]

11:基板

21: ゲート電極

31:絶縁体層

4 1:ドレイン電極

51:有機薄膜層

6 1: ソース電極

12:基板

22: ゲート電極

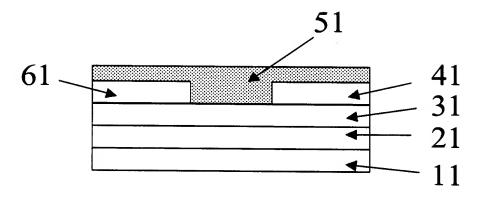
3 2 : 絶縁体層

42:ドレイン電極

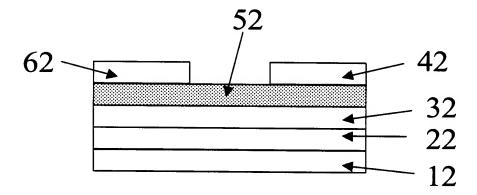
52:有機薄膜層

62:ソース電極

【書類名】図面【図1】



【図2】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】

有機トランジスタにおける有機半導体層として好適な化合物と、それを用いた、従来よりも高い駆動速度の有機トランジスタを提供する。

【解決手段】

有機半導体層を有するトランジスタにおいて、該有機半導体層が下記式(1)で表されるテトラカルボン酸誘導体を含むことを特徴とする有機トランジスタ。

$$X-N$$
 Z_1
 N
 Z_2
 $N-Y$

... (1)

[式中、X、Yは、それぞれ独立に水素原子、置換または未置換のアリール基、置換または未置換のアルキル基、置換または未置換のシクロアルキル基、置換または未置換のアラルキル基からなる群より選ばれる基を表す。また、式中、 Z_1 、 Z_2 は、それぞれ独立にテトラカルボン酸及びその誘導体を構成する 4 価の有機基を表す。]

【選択図】 なし

出願人履歴

000000588720031104 住所変更

東京都港区東新橋一丁目5番2号三井化学株式会社